

令和3年度 第5回 ナノファブスクエア in 海老名 講習・実習会

ナノパターン形成

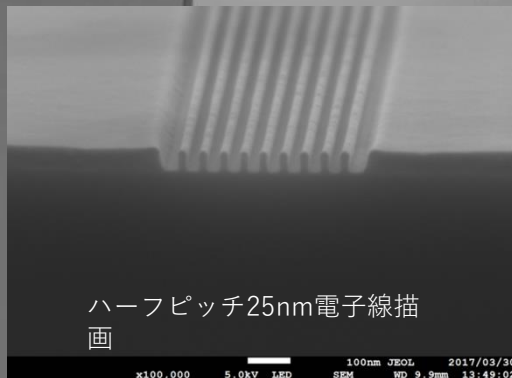


川崎市

初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定



日時

令和3年6月24日(木)
13:30~16:30

場所

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)
海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1
小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

黒内 正仁 (神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

電子線描画装置によるレジストへのナノパターンの形成の実習を行います。

実習機器

- 電子線描画装置 (株)エリオニクス製 ELS-S50

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員：先着5名程度 参加費：11,000円(実費)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所、川崎市

問い合わせ先

(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel: 046-236-1500 (代表)
技術担当 三橋 雅彦 電子技術部 /E-mail: mitsu@kistec.jp
事務担当 陶山、津島 人材育成部 /E-mail: sm_sangyoujinzai@kistec.jp